

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】令和4年9月2日(2022.9.2)

【公開番号】特開2021-39302(P2021-39302A)
 【公開日】令和3年3月11日(2021.3.11)
 【年通号数】公開・登録公報2021-013
 【出願番号】特願2019-161966(P2019-161966)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/023(2006.01)

C 0 8 G 8/08(2006.01)

G 0 3 F 7/004(2006.01)

10

【F I】

G 0 3 F 7/023 5 1 1

C 0 8 G 8/08

G 0 3 F 7/004 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】令和4年8月25日(2022.8.25)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0087

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0087】

電子顕微鏡を用いて、エッチング処理後の表面を観察し、SiO₂パターン11aの頂部幅Wを計測した。ノボラック型フェノール樹脂(A8)のみを用いた場合の頂部幅を基準値(W0)として、下記数式により密着性(%)を算出した。

30

40

50